表１-1．装置等の利用負担金表

令和7年4月1日 改定

装置等				利用料金(一時間当り)						設置場所	
	No.	機器名	メーカ名	タイプA 65%OFF	タイプB 50%OFF	タイプC 44%OFF	タイプD 30%OFF	タイプE 20%OFF	タイプF 基準料金		
Aナノリソグラフィー装置	A01	高速高精度電子ビーム描画装置	ELIONIX／ELS-F125HS	31,680円	45,260円	50,690円	63,360円	72,410円	90,520円	吉田	イエロールーム
	A02	露光装置（ステッパー）	NIKON／NSR-2205i11D	12,670円	18,100円	20,280円	25,340円	28,970円	36,210円	吉田	イエロールーム
	A03	レーザー直接描画装置	Heidelberg Instruments／DWL2000	8,600円	12,280円	13,760円	17,200円	19,650円	24,570円	吉田	イエロールーム
	A06	紫外線露光装置	MIKASA／MA-10	530円	760円	850円	1,060円	1,210円	1,510円	吉田	イエロールーム
	A07	厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置	SUSS MicroTec／DELTA80 T3/VP SPEC-KU	1,860円	2,660円	2,980円	3,730円	4,260円	5,330円	吉田	イエロールーム
	A08	レジスト塗布装置	KANAMEX／KRC-150CBU	950円	1,360円	1,520円	1,900円	2,170円	2,710円	吉田	イエロールーム
	A09	スプレーコータ	Ushio／USC-2000ST	1,210円	1,720円	1,930円	2,410円	2,760円	3,450円	吉田	イエロールーム
	A10	レジスト現像装置	KANAMEX／KD-150CBU	950円	1,360円	1,520円	1,900円	2,170円	2,710円	吉田	イエロールーム
	A11	ウエハスピン洗浄装置	KANAMEX／KSC-150CBU	1,770円	2,520円	2,820円	3,530円	4,030円	5,040円	吉田	イエロールーム
	A12	ICP質量分析装置	Agilent Technologies／Agilent7700s	2,940円	4,200円	4,710円	5,880円	6,720円	8,410円	吉田	加工・評価室
	A14	有機現像液型レジスト現像装置	KANAMEX／KD(EB)-150CBU	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	吉田	イエロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	ADVANTEST／F7000S-KYT01	55,760円	79,650円	89,210円	111,520円	127,450円	159,310円	吉田	加工評価室（クリーンルーム）
	A16	近接効果補正システム	GenISys／BEAMER Full Package	1,100円	1,570円	1,760円	2,200円	2,510円	3,140円	吉田	サテライトオフィス
	A17	超臨界洗浄・乾燥装置	Rexxam／SCRD401	720円	1,030円	1,160円	1,450円	1,650円	2,070円	吉田	イエロールーム
	A18	高圧ジェットリフトオフ装置	KANAMEX／KLO-200SV1	2,400円	3,430円	3,840円	4,800円	5,480円	6,850円	吉田	イエロールーム
	A19 旧B16	両面マスク露光&ボンドアライメント装置	SUSS MicroTec／MA/BA8 Gen3 SPEC-KU	5,420円	7,740円	8,670円	10,840円	12,390円	15,490円	吉田	イエロールーム
	A21	マスクレス露光装置	Heidelberg Instruments／MLA150	6,300円	9,000円	10,080円	12,590円	14,390円	17,990円	吉田	イエロールーム
	A22	二光子重合式3Dプリンター	Heidelberg Instruments／MPO100	5,650円	8,070円	9,040円	11,300円	12,910円	16,140円	吉田	イエロールーム
	A53	移動マスク紫外線露光装置	Japan Science Engineering／MUM-0001	5,170円	7,390円	8,280円	10,340円	11,820円	14,780円	桂	桂/クリーンルーム
	A54	両面マスクアライナ露光装置	Union Optical／PEM-800	810円	1,160円	1,300円	1,620円	1,850円	2,320円	桂	桂/クリーンルーム
	A55 旧A05	両面マスクアライナー	SUSS MicroTec／MA6 BSA SPEC-KU/3	3,420円	4,880円	5,470円	6,830円	7,810円	9,760円	桂	桂/クリーンルーム
	A56 旧A04	高速マスクレス露光装置	NanoSystem Solutions／DL-1000GS/KCH	4,890円	6,980円	7,820円	9,780円	11,170円	13,970円	桂	イエロールーム
	A57 旧A13	超微細インクジェット描画装置	SIJTechnology／ST050	1,290円	1,840円	2,060円	2,580円	2,950円	3,690円	桂	イエロールーム
Bナノ材料加工・創製装置	B01	多元スパッタ装置（仕様Ａ）	CANON ANELVA／EB-1100	4,840円	6,920円	7,750円	9,690円	11,070円	13,840円	吉田	加工・評価室
	B02	多元スパッタ装置（仕様Ｂ）	CANON ANELVA／EB-1100	4,610円	6,590円	7,380円	9,220円	10,540円	13,170円	吉田	加工・評価室
	B03	電子線蒸着装置	CANON ANELVA／EB-1200	3,800円	5,430円	6,080円	7,600円	8,690円	10,860円	吉田	クリーンルーム１
	B05	プラズマCVD装置	Sumitomo Precision Products／MPX-CVD	7,690円	10,990円	12,310円	15,390円	17,590円	21,980円	吉田	クリーンルーム１
	B06	集束ｲｵﾝﾋﾞｰﾑ走査電子顕微鏡	SII NanoTechnology／NVision40PI	15,520円	22,170円	24,830円	31,030円	35,470円	44,330円	吉田	加工・評価室
	B07	熱酸化炉	Koyo Thermo Systems／MT-8X28-A	1,120円	1,600円	1,800円	2,250円	2,570円	3,210円	吉田	クリーンルーム２
	B09	磁気中性線放電ドライエッチング装置	ULVAC／NLD-570	6,340円	9,050円	10,140円	12,670円	14,480円	18,100円	吉田	クリーンルーム１
	B10	ドライエッチング装置	Samco／RIE-10NR-KF	1,090円	1,550円	1,740円	2,170円	2,480円	3,100円	吉田	クリーンルーム２
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	ELIONIX／EIS-1200	4,340円	6,210円	6,950円	8,690円	9,930円	12,410円	吉田	クリーンルーム２
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	Sumitomo Precision Products／MLT-SLE-Ox	5,070円	7,250円	8,120円	10,150円	11,600円	14,490円	吉田	クリーンルーム１
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	Xactix／Xetch X3B	2,560円	3,650円	4,090円	5,120円	5,850円	7,310円	吉田	クリーンルーム２
	B14	赤外フェムト秒レーザ加工装置	AVESTA PROJECT／CrF-65	4,250円	6,080円	6,810円	8,510円	9,720円	12,160円	吉田	第２加工・評価室
	B15	レーザアニール装置	AOV／LAEX-1000	4,040円	5,760円	6,460円	8,070円	9,220円	11,530円	吉田	第２加工・評価室
	B17	基板接合装置	SUSS MicroTec／SB8e SPEC-KU	4,930円	7,040円	7,880円	9,850円	11,260円	14,070円	吉田	イエロールーム
	B18	レーザダイシング装置	TOKYO SEIMITSU／Mahoh Dicer ML200	8,130円	11,610円	13,000円	16,260円	18,580円	23,220円	吉田	加工・評価室
	B19	ダイシングソー	DISCO／DAD322	730円	1,050円	1,180円	1,470円	1,680円	2,100円	吉田	加工・評価室
	B20	真空マウンター	NEC／VTL-201	630円	910円	1,010円	1,270円	1,450円	1,810円	吉田	加工・評価室
	B21	紫外線照射装置	Technovision／LED-4082	280円	400円	450円	560円	640円	800円	吉田	加工・評価室
	B22	エキスパンド装置	Technovision／TEX-21BG GR-5	150円	210円	240円	300円	340円	420円	吉田	加工・評価室
	B23	ウェッジワイヤボンダ	West Bond／7476D	320円	450円	510円	630円	720円	910円	吉田	第２加工・評価室
	B24	ボールワイヤボンダ	West Bond／7700D	320円	460円	520円	650円	740円	930円	吉田	第２加工・評価室
	B25	ダイボンダ	West Bond／7200CR	290円	420円	470円	590円	670円	840円	吉田	第２加工・評価室
	B27	赤外透過評価検査／非接触厚み測定機	MORITEX／Irise-T	1,220円	1,740円	1,950円	2,430円	2,780円	3,480円	吉田	クリーンルーム１
	B29	高性能マッフル炉	AS ONE／HPM-2N	50円	70円	80円	100円	120円	150円	吉田	第２加工・評価室
	B30	UVオゾンクリーナー・キュア装置	Samco／UV-300HKU	670円	960円	1,070円	1,340円	1,530円	1,910円	吉田	クリーンルーム２
	B31	水蒸気プラズマクリーナー	Samco／AQ-500KU	1,090円	1,550円	1,740円	2,170円	2,480円	3,100円	吉田	クリーンルーム２
	B32 B33	真空蒸着装置	SANVAC／RD-1400	750円	1,070円	1,200円	1,490円	1,710円	2,130円	吉田	加工・評価室
	B34	深堀りドライエッチング装置	Samco／RIE-800iPB-KU	6,320円	9,030円	10,110円	12,640円	14,440円	18,050円	吉田	クリーンルーム１
	B36	誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置	ULVAC／Gemini-200E	6,830円	9,760円	10,930円	13,670円	15,620円	19,530円	吉田	クリーンルーム１
	B37	赤外線ランプ加熱装置	ADVANCE RIKO／RTP-6	410円	580円	650円	820円	930円	1,170円	吉田	加工・評価室
	B38	原子層堆積装置	Samco／AD-800LP-KN	6,500円	9,280円	10,400円	13,000円	14,860円	18,570円	吉田	クリーンルーム１
	B39	UVナノインプリント装置	EVG／EVG6200TBN	4,960円	7,090円	7,940円	9,920円	11,340円	14,170円	吉田	イエロールーム
	B40	熱インプリント装置	EVG／EVG510	3,150円	4,500円	5,040円	6,300円	7,200円	9,000円	吉田	イエロールーム
	B51	パリレン成膜装置	Specialty Coating Systems／PDS-2010	430円	610円	690円	860円	980円	1,230円	桂	桂/クリーンルーム
	B52	ICP-RIE装置	ULVAC／NE-730	600円	860円	970円	1,210円	1,380円	1,720円	桂	桂/クリーンルーム
	B53	簡易RIE装置	Samco／FA-1	390円	560円	620円	780円	890円	1,110円	桂	桂/クリーンルーム
	B54	ウエハ接合装置	Bondtech／WAP-100	5,470円	7,810円	8,740円	10,930円	12,490円	15,610円	桂	桂/クリーンルーム
	B55	ナノインプリント装置	MARUNI／TP-32937	210円	300円	340円	420円	480円	610円	桂	桂/クリーンルーム
	B56	ダイシング装置	DISCO／DAD322	690円	980円	1,100円	1,380円	1,570円	1,970円	桂	桂/化学処理室
	B57 旧B26	ナノインプリントシステム	OBDUCAT／Eitre3	1,290円	1,840円	2,060円	2,580円	2,950円	3,690円	桂	桂/クリーンルーム
	B58 旧B28	電子線蒸着装置（２）	Osaka Vacuum／OVE-350	490円	690円	780円	970円	1,110円	1,390円	桂	桂/クリーンルーム
	B59 旧B35	深堀りドライエッチング装置	Samco／RIE-800iPB-KU	6,320円	9,030円	10,110円	12,640円	14,440円	18,050円	桂	桂/クリーンルーム
	No.	機器名	メーカ名	タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF	設置場所	

表１-2．装置等の利用負担金表

令和7年4月1日 改定

装置等				利用料金(一時間当り)						設置場所	
	No.	機器名	メーカ名	タイプA 65%OFF	タイプB 50%OFF	タイプC 44%OFF	タイプD 30%OFF	タイプE 20%OFF	タイプF 基準料金		
C ナノ材料分析・評価装置	C01	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies／SU8000	5,780円	8,260円	9,250円	11,570円	13,220円	16,530円	吉田	加工・評価室
	C02	分析走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies／SU6600	8,060円	11,510円	12,890円	16,110円	18,410円	23,020円	吉田	加工・評価室
	C03	高速液中原子間力顕微鏡	RIBM／NanoLiveVision NLV-KS	3,080円	4,400円	4,920円	6,150円	7,030円	8,790円	吉田	設備サポート拠点
	C04	走査型プローブ顕微鏡システム	JPK Instruments／NanoWizard III	2,800円	4,000円	4,480円	5,600円	6,400円	8,000円	吉田	第２加工・評価室
	C05	共焦点レーザー走査型顕微鏡	Olympus／FV1000	3,000円	4,280円	4,790円	5,990円	6,850円	8,560円	吉田	第２加工・評価室
	C06	3D測定ﾚｰｻﾞｰ顕微鏡	Olympus／OLS4000-SAT	1,200円	1,720円	1,930円	2,410円	2,750円	3,440円	吉田	加工・評価室
	C08	全反射励起蛍光イメージングシステム	Olympus／	2,450円	3,500円	3,920円	4,900円	5,600円	7,000円	吉田	設備サポート拠点
	C09	長時間撮影蛍光イメージングシステム	Olympus／IX81-ZDC2	1,860円	2,660円	2,980円	3,720円	4,250円	5,320円	吉田	設備サポート拠点
	C10	X線回折装置	Rigaku／SmartLab	3,260円	4,660円	5,210円	6,520円	7,450円	9,310円	吉田	加工・評価室
	C11	分光エリプソメーター	Otsuka Electronics／FE-5000	1,990円	2,840円	3,180円	3,970円	4,540円	5,670円	吉田	クリーンルーム２
	C12	光ピンセットシステム	JPK Instruments／NanoTracker	2,350円	3,360円	3,760円	4,700円	5,370円	6,710円	吉田	設備サポート拠点
	C13	ゼータ電位・粒径測定システム	Otsuka Electronics／ELSZ-2Plus	1,290円	1,840円	2,060円	2,570円	2,940円	3,680円	吉田	第２加工・評価室
	C14	ダイナミック光散乱光度計	Otsuka Electronics／DLS-8000DH	1,710円	2,450円	2,740円	3,420円	3,910円	4,890円	吉田	第２加工・評価室
	C16	マイクロシステムアナライザ	Polytec／MSA-500-TPM2-20-D	3,390円	4,850円	5,430円	6,790円	7,760円	9,700円	吉田	加工・評価室
	C17	（プローバ）	MICRONICS／Model 708fT	760円	1,080円	1,210円	1,510円	1,730円	2,160円	吉田	加工・評価室
	C18	（真空プローバ）	Cascade Microtech／PLV50	2,960円	4,230円	4,740円	5,920円	6,760円	8,460円	吉田	加工・評価室
	C19	パワーデバイスアナライザ＋（C17プローバ）	Agilent Technologies／B1505A	960円	1,370円	1,530円	1,910円	2,190円	2,740円	吉田	加工・評価室
	C20	インピーダンスアナライザ＋（C18真空ﾌﾟﾛｰﾊﾞ）	Agilent Technologies／4294A	400円	570円	630円	790円	910円	1,130円	吉田	加工・評価室
	C21	光ヘテロダイン微小振動測定装置	NEOARK／MLD-230D-200K	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	吉田	第２加工・評価室
	C22	超微小材料機械変形評価装置	ELIONIX／ENT-2100	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	吉田	第２加工・評価室
	C24	セルテストシステム	Solartron Analytical	1,260円	1,800円	2,010円	2,520円	2,870円	3,590円	吉田	第２加工・評価室
	C25	卓上顕微鏡(SEM)	Hitachi High-Technologies／TM3000	470円	670円	750円	930円	1,070円	1,340円	吉田	イエロールーム
	C26	高周波伝送特性測定装置（C27+C28+C29）	APOLLOWAVE／α150	420円	600円	670円	840円	960円	1,200円	吉田	加工・評価室
	C27	（RFプローブキット）	Cascade Microtech／ZPROBE	170円	250円	280円	340円	390円	490円	吉田	加工・評価室
	C28	（ネットワークアナライザ）	ROHDE&SCHWARZ／ZVB14	430円	610円	680円	850円	970円	1,220円	吉田	加工・評価室
	C29	（半導体パラメータアナライザ）	Keithley Instruments／4200-SCS	420円	600円	670円	840円	960円	1,200円	吉田	加工・評価室
	C30	強誘電体特性評価システム	TOYO／FCE-3	860円	1,230円	1,380円	1,720円	1,970円	2,460円	吉田	加工・評価室
	C31	接触式シート抵抗測定器	NAPSON／Cresbox	370円	530円	590円	740円	850円	1,060円	吉田	加工・評価室
	C32 C33	触針式段差計	Veeco Instruments／Dektak150	550円	790円	880円	1,100円	1,260円	1,580円	吉田	クリーンルーム２ 加工・評価室
	C34	ウエハプロファイラ	KLA／Zeta-388	6,520円	9,310円	10,430円	13,030円	14,900円	18,620円	吉田	クリーンルーム２
	C35	触針式形状測定装置	Buruker／DektakPro	860円	1,230円	1,380円	1,720円	1,970円	2,460円	吉田	クリーンルーム２
	C51	光干渉膜厚計	FILMETRICS／F20	290円	420円	470円	590円	670円	840円	桂	桂/化学処理室
D ナノ微細構造解析装置	D01	極低温高分解能透過電子顕微鏡	JEOL／JEM-2100F(G5)	7,900円	11,280円	12,630円	15,790円	18,050円	22,560円	宇治	-
	D02	球面収差補正透過電子顕微鏡	JEOL／JEM-2200FS	5,990円	8,550円	9,580円	11,970円	13,680円	17,100円	宇治	-
	D03	モノクロメータ搭載低加速原子分解能分析電子顕微鏡	JEOL／JEM-ARM200F	8,980円	12,840円	14,380円	17,970円	20,540円	25,670円	宇治	-
	D05	ミクロトーム	Leica／ULTRACUT UCT	540円	780円	870円	1,090円	1,240円	1,550円	宇治	-
	D08	デュアルビーム走査電子顕微鏡（FIB-SEM）	JEOL／JIB-4700F	11,630円	16,620円	18,610円	23,260円	26,580円	33,230円	宇治	-
	D09	イオンスライサー	JEOL／IB-09060CIS	1,370円	1,950円	2,180円	2,730円	3,120円	3,900円	宇治	-
	No.	機器名	メーカ名	タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF	設置場所	

備　考

１　上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された１時間当たりの機器利用に係る金額（消費税相当額を含む）であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。

・タイプＡ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
（標準利用負担金（タイプF）の額の３５％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプＢ：学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用、中小企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
（標準利用負担金（タイプF）の額の５０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプＣ：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供あり）に基づく利用
（標準利用負担金（タイプF）の額の５６％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプD：中小企業を除く企業のARIM事業（データ提供なし）に基づく利用
（標準利用負担金（タイプF）の額の７０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプE：ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用
（標準利用負担金（タイプF）の額の８０％を１０円単位で四捨五入した額とする。）

・タイプF：ARIM事業に基づかない企業の単独利用

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

２　１時間未満の機器利用及び１時間を超える機器利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。

３　複数の機器を利用する場合については、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。

４　上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。

５　中小企業とは中小企業基本法第２条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

業種分類	中小企業基本法の定義
製造業その他	資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸　売　業	資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小　売　業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業	資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

表２．装置等の利用負担金の上限

利用者種別	利用料（１テーマ当たり）
下記のうち、ARIM事業（データ提供あり）に基づく利用者 ・　京都大学の教職員及び学生 ・　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 ・　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者	４００万円
下記のうち、ARIM事業（データ提供なし）に基づく利用者、またはARIM事業に基づかない利用者 ・　京都大学の教職員及び学生 ・　学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 ・　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者	６００万円
上記以外の者	１，７００万円

備　考

１　上記表中の装置利用料は、１テーマ当たりの利用に係る上限額（消費税相当額を含む）です。なお、1テーマの継続期間6ケ月です。

表３．技術代行における技術料

１時間当たり
8,800円

備　考

１　上記表中の料金は、１時間の技術代行にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

２　１時間未満の技術代行及び１時間を超える技術代行に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術代行として、技術料を算出するものとします。

３　技術代行においても、上記の装置利用負担金及び表４の基本料金を負担いただきます。

表４．基本料金表

利用者種別	基本料金（1装置・1時間当たり）
(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生 (2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者 (4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業	５３０円
(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生 (6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者 (8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業	７５０円
(9) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業	８４０円
(10) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業	１，０５０円
(11) 企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者	１，２００円
(12)　企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者 (13)　その他、上記（1)～(12)に該当しない者	１，５００円

備　考

１　上記表中の基本料金は、１装置・１時間当たりの料金であり、これに各装置の利用時間を乗じた金額をご負担頂きます。（基本料金は装置維持管理等に係る費用の一部に充当します。）

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

表５．サテライトラボ（専有部分）・セミナー室（実験室等という）の利用料金

実 験 室 等	利用料	
	１日当たり・１平方メートル当たり	１時間当たり・１平方メートル当たり
サテライトラボ （専有部分） セミナー室	１６８円	２１円

備　考

１　上記表中の料金は、実験室等の床面積１平方メートルあたりの１日又は１時間の利用にかかる金額（消費税相当額を含む）であり、 これに当該実験室等の床面積及び利用日数又は利用時間数を乗じた金額とします。

２　１時間未満の実験室等利用及び１時間を超える実験室等利用に係る１時間未満の端数については、それぞれ１時間の実験室等利用と利用料金を算出するものとします。

３　複数の実験室等を利用する場合については、各実験室等の利用料を合算した金額を利用料金とします。

表６．装置等の利用中止に伴うキャンセル料

区　　分	キャンセル料
装置利用日の６営業日前から２２営業日前まで	利用負担金の額の２５％
装置利用日の４営業日前から５営業日前まで	利用負担金の額の５０％
装置利用日当日から３営業日前まで	利用負担金の額の１００％

備　考

１　キャンセル料に円未満の端数が出た場合は、その端数を切り上げるものとします。

表７．技術補助における技術料

１時間当たり
８,８００円

備　考

１　技術補助とは、利用者からの依頼、もしくはナノハブ職員からの提案に基づいて行う下記のような業務です。

(1)　ナノハブ職員が、利用時に立ち会って適宜行う装置操作等の補助
(2)　ナノハブ職員との利用開始後の技術相談（なお、利用開始前の技術相談は無料です。）
(3)　ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプロセス条件最適化検討
(4)　ナノハブ職員が、対象となる利用者のために行う個別対応のプログラミング

２　上記表中の料金は、１時間の技術補助にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を技術料とします。
なお、上記の利用時間は、装置時間と事前検討に要する時間等を合計した時間とします。

３　１時間未満の技術補助及び１時間を超える技術補助に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の技術補助として、技術料を算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

表8．事前講習費（オペトレ費）

※技術講習とは、利用者が初めて使用する装置について、事前に操作法などを修得していただく講習です。

利用者種別	事前講習費（1時間当たり）	
	標準試料を用いた 事前講習	標準試料以外の 試料を用いた事前講習
(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生 (2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者 (4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業	１，５４０円	３，０８０円
(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生 (6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者 (8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業	２，２００円	４，４００円
(9) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業	２，４６０円	４，９３０円
(10) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業	３，０８０円	６，１６０円
(11)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者	３，５２０円	７，０４０円
(12)　企業等に属しナノテクノロジープラットフォーム事業に基づかないで利用する者 (13)　その他、上記（1)～(7)に該当しない者	４，４００円	８，８００円

備　考

１　上記表中の料金は、１時間の事前講習にかかる金額(消費税相当額を含む。)であり、 これに利用時間数を乗じた金額を事前講習費とします。

２　１時間未満の事前講習及び１時間を超える事前講習に係る１時間未満の端数については、 それぞれ１時間の事前講習として、算出するものとします。
但し、短時間で対応可能な場合は除きます。

３　なお安全教育（初めてナノハブを利用される方に対して、施設・装置の利用に関する注意点をお伝えするもの）については無料です。

４　上記事前講習費に加えて、下記料金を合わせて負担していただきます。
・表９に示す事前講習時の装置利用負担金
・表４に示した基本料金
・事前講習に要する消耗品費

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」

表9．事前講習費時の装置負担金

事前講習に用いる試料と利用者種別によって下表のように区分してます。

利用者種別	ナノハブ拠点の準備する 標準試料を用いた 事前講習時の装置利用負担金	ナノハブ拠点の準備する 標準試料以外の試料を用いた 事前講習時の装置利用負担金
(1)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する京都大学の教職員及び学生 (2)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (3)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供あり）の利用者 (4)　ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業	表１（タイプＡ）に示した 装置利用負担金の半額	表１（タイプＡ）に示した 装置利用負担金
(5)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する京都大学の教職員及び学生 (6)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する学術研究を目的とする機関に所属し、研究に従事する者 (7)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業（データ提供なし）の利用者 (8)　ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業	表１（タイプＢ）に示した 装置利用負担金の半額	表１（タイプＢ）に示した 装置利用負担金
(9) ARIM事業（データ提供あり）を利用する中小企業以外の企業	表１（タイプC）に示した 装置利用負担金の半額	表１（タイプC）に示した 装置利用負担金
(10) ARIM事業（データ提供なし）を利用する中小企業以外の企業	表１（タイプD）に示した 装置利用負担金の半額	表１（タイプD）に示した 装置利用負担金
(11)　企業等に所属し、研究開発に従事する者のうち学術研究を目的とする機関と共同で研究を実施する者でかつ、ARIM事業に基づかない利用者	表１（タイプE）に示した 装置利用負担金の半額	表１（タイプE）に示した 装置利用負担金
(12)　企業等に属しARIM事業に基づかないで利用する者 (13)　その他、上記（1)～(12)に該当しない者	表１（タイプF）に示した 装置利用負担金の半額	表１（タイプF）に示した 装置利用負担金

注）ARIM事業：文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」